(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



. | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1

(43) Date de la publication internationale 6 décembre 2001 (06.12.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/93256 A1

(51) Classification internationale des brevets7: G11B 7/24

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/01660

(22) Date de dépôt international: 29 mai 2001 (29.05.2001)

(25) Langue de dépôt :

rançais

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 00/06911 30 mai 2

30 mai 2000 (30.05.2000) F

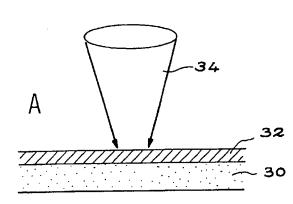
(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR). MOULAGE PLASTIQUE DE L'OUEST [FR/FR]; Domaine de Lorgerie, F-53700 Averton (FR).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement):
 POUPINET, Ludovic [FR/FR]; 162, Avenue Victor
 Hugo, F-38170 Seyssinet (FR). BECHEVET, Bernard
 [FR/FR]; Lotissement "La Cascade", Cedex 334, F-38640
 Claix (FR). ARMAND, Marie-Françoise [FR/FR]; 354,
 chemin des Chartreux, F-38410 Vaulnaveys-le-Haut (FR).
 PERRIER, Robin [FR/FR]; 25, avenue Jean Jaurès,
 F-73200 Albertville (FR). FALLOU, Olivier [FR/FR]; 13
 bis, rue des Plantes, F-75014 Paris (FR).
- (74) Mandataire: LEHU, Jean; Brevatome, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

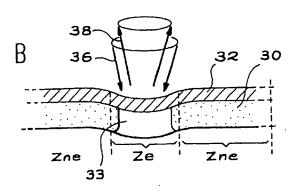
[Suite sur la page suivante]

(54) Title: IRREVERSIBLE OPTICAL RECORDING MEDIUM

(54) Titre: SUPPORTS D'ENREGISTREMENT OPTIQUE IRREVERSIBLE



- (57) Abstract: The invention concerns a medium comprising a two-layered stack consisting of an inorganic layer (30) and a semi-reflecting layer (32). The inorganic layer (30) is adapted to be deformed under the effect of a light radiation (34) directed through the semi-reflecting layer, thereby reducing the reflection coefficient of the stack. The invention is useful for irreversibly recording data, for example on discs.
- (57) Abrégé: Le support comprend un empilement bicouche constitué d'une couche inorganique (30) et d'une couche semi-ré-fléchissante (32). La couche inorganique (30) est apte à se déformer sous l'effet d'un rayonnement lumineux (34) adressé à travers la couche semi-réfléchissante ce qui abaisse le coefficient de réflexion de l'empilement. Application à l'enregistrement irréversible d'informations, par exemple sur disques.



WO 01/93256 A1



- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GII, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen

(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

1

SUPPORTS D'ENREGISTREMENT OPTIQUE IRREVERSIBLE

DESCRIPTION

5 Domaine technique

10

15

20

La présente invention a pour objet des supports d'enregistrement optique irréversible, respectivement pour l'écriture et pour la lecture d'informations. L'enregistrement est irréversible en ce sens que l'écriture n'a lieu qu'une fois, sans possibilité d'effacement ni de réécriture. La lecture en revanche, peut être répétée.

L'invention trouve une application, par exemple, dans l'enregistrement sur disque optique de type CD-R ("Compact Disc Recordable"), WORM ("Write-Once Read Many"), DRAW ("Direct Read After Write") ou encore DVD-R ("Digital Versatile Disc Recordable").

Mais l'invention ne se limite pas au cas des disques. Elle couvre tout support, de quelque forme que ce soit (bande, carte, etc.).

Etat de la technique antérieure

Dans le domaine de l'enregistrement optique irréversible, le CD-R, compatible avec le CD ("Compact Disc"), s'est rapidement imposé comme un standard mondial. L'évolution de la production mondiale atteste très clairement de ce phénomène : 862 millions de disques en 1998, 2078 millions en 1999. Le prix actuel d'un CD-R est inférieur à 1\$ et une baisse de 30% est attendue dans les deux ans à venir. Le CD-R n'est donc plus seulement utilisé pour l'enregistrement personnel

2

mais également pour la réalisation de petites séries de disques, en lieu et place du pressage de CD ou de CD-ROM. La durée de vie économique du produit est difficile à estimer. Les plus optimistes pensent que le CD-R pourrait ne pas souffrir de la concurrence du CD-RW ("Compact Disc Readable Writable") et de la famille DVD. En particulier, dans le domaine informatique, le CD-R pourrait remplacer définitivement la disquette, avec une capacité 400 fois supérieure.

10 Actuellement, la grande majorité des disques utilise une technique à base de colorant organique. La structure du disque est illustrée sur la figure 1 annexée.

Le support d'enregistrement représenté 15 comprend :

- un substrat transparent 10 (en polycarbonate par exemple),
- une couche 12 de colorant sensible aux longueurs d'onde comprise entre 7750 et 7950Å,
- 20 une couche réfléchissante 14, en alliage d'or ou d'argent par exemple,
 - une ou deux couches de protection 16.

25

30

Les données sont écrites sur le disque en focalisant un faisceau optique 18 émis par un laser de forte puissance. Le faisceau atteint la couche 12 de colorant à travers le substrat 10. La lumière absorbée par le colorant chauffe celui-ci et entraîne une modification irréversible de la structure optique. Cette modification peut se limiter au colorant, mais elle peut également atteindre les matériaux environnants : substrat 10 ou couche réfléchissante 14.

3

Les données sont enregistrées sous forme d'alternance de zones non-écrites de forte réflexion et de zones écrites de faible réflexion. Le codage des données est obtenu par la variation de longueur des marques inscrites.

La lecture des données est obtenue avec un faisceau lumineux de lecture issu d'une diode laser de faible puissance.

Les données sont inscrites en spirale sur la surface du disque. Le suivi de cette spirale est rendu possible, à la lecture comme à l'écriture, par la présence d'un sillon pré-gravé dans le substrat. Les données ne sont inscrites que dans le sillon ("groove"). La zone vierge de la spirale est appelée "land".

Cette technologie présente un certain nombre de problèmes liés au vieillissement des produits organiques (par la lumière ou la température par exemple), à la grande sensibilité du colorant à la longueur d'onde (problème de compatibilité entre formats de type CD et DVD par exemple), au coût de l'étape de dépôt du colorant (durée, entretien, coût de la matière première).

20

25

30

Le dernier problème, notamment, renforce l'intérêt d'une autre solution qui permettrait d'abaisser les coûts de production. En particulier, dans les pays où le coût de la main d'oeuvre est élevé, suivre la tendance du marché sera difficile. Ainsi, en 1998, 37% de la production mondiale se faisait à Taïwan contre 60% en 1999. Une solution intéressante

WO 01/93256

5

15

4

PCT/FR01/01660

consisterait à remplacer le produit organique par un produit inorganique. Mais d'autres difficultés apparaissent alors :

- le passage d'une réflexion forte, pour le disque vierge, à une réflexion faible pour les points inscrits doit être conservé pour permettre la compatibilité avec le matériel existant (graveurs et lecteurs),
- une sensibilité suffisante doit être préservée pour
 que la puissance d'écriture soit dans la gamme accessible aux graveurs actuels à vitesse de gravure donnée,
 - une qualité d'écriture suffisante (fort rapport signal à bruit, faible jigue ou "jitter", faible asymétrie) doit être obtenue pour garantir une écriture et une lecture satisfaisante,
 - la durée de vie doit être suffisante en dépit du vieillissement dû à la température, au soleil, aux chocs et aux rayures.
- La résolution simultanée de ces problèmes est difficile. De plus, les réalités industrielles imposent l'usage de technologies de dépôt éprouvées et rapides. Il s'agit, le plus souvent, de pulvérisation, et non d'évaporation, par exemple, souvent trop lente. De même, la réduction des coûts pousse à minimiser le nombre de postes de pulvérisation et donc le nombre de matériaux et de couches, voire même l'épaisseur de ces dernières.

L'utilisation de matériaux inorganiques pour 30 l'enregistrement irréversible est envisagée depuis longtemps. Le tellure et ses alliages ont fait l'objet

30

d'études avant même l'apparition des colorants. Depuis que ces derniers se sont imposés, de nouveaux matériaux font régulièrement leur apparition dans ce domaine. Parmis ces solutions, peu sont compatible avec le matériel existant de gravure et de lecture. 5 solutions très variées ont pourtant été étudiées [1] : Formation de trous [2] : Il s'agit de la méthode qui a été le plus étudiée dans les années 80. Elle consiste à créer un trou dans la couche active à l'aide d'une impulsion lumineuse intense. Les matériaux les plus 10 utilisés dans cette technique sont In, Bi, Te et divers chalcogénures (en excluant l'utilisation de matériaux organiques). Tous ces matériaux ont en commun un bas point de fusion et une grande absorption.

Formation de bulles [3]: Classiquement, la couche active comporte une couche métallique (alliage d'or ou de platine) et une couche de polymère organique. L'élévation de température dans la couche métallique est transférée à la couche de polymère ce qui se traduit par une décomposition de ce dernier et une émission de gaz. Ce gaz détache la couche métallique du substrat. L'éclatement de la bulle peut être évité en optimisant les paramètres de la couche active. Les travaux concernant AgO_x sont également à ranger dans cette catégorie.

Ségrégation : [4] Le constituant de la couche se décompose sous irradiation laser. Les sous-oxydes sont de bons candidats, par exemple $TeO_{1,1}$. Ce matériau se décompose en TeO_2 et Te après irradiation. Te étant réfléchissant, le point inscrit est plus réfléchissant que son entourage.

6

de phase cristallin-amorphe : Certains Changement matériaux étudiés dans le cadre de l'ablation sont proches des matériaux à changement de phase. On peut donc imaginer que des matériaux employés habituellement pour l'enregistrement par changement de phase sont utilisables de manière irréversible dans le cadre de l'ablation. Cependant, pour que l'écriture de données de phase se traduise changement modification de la réflexion d'une valeur haute à une valeur basse, le matériau doit passer de l'état 10 cristallin à l'état amorphe. Or, le matériau est dans un état amorphe après son dépôt sur le substrat. L'écriture par changement de phase nécessite donc une étape d'initialisation qui consiste à cristalliser le matériau sur toute la surface du disque. Cette étape 15 représente un coût non négligeable dans la fabrication d'un disque de ce type. Enfin, le contrôle des effets thermiques dans le disque nécessite souvent la présence à quatre couches, dont certaines, trois de diélectriques, peuvent être relativement épaisses. 20 L'utilisation d'une écriture irréversible basée sur le changement de phase ne paraît donc pas intéressante du point de vue économique.

Changement de texture [5] : Cette technique concerne en général des couches actives à base de germanium ou de silicium. La surface rugueuse de la couche devient lisse après irradiation laser. La réflexion passe donc d'une valeur basse à une valeur élevée. Ce n'est pas le sens du changement recherché. D'autre part, ces disques comportent souvent un niveau de bruit élevé.

25

30

7

A la connaissance des Demandeurs, un disque ayant plus de 60% de réflexion avec une seule couche de matériau inorganique ne peut être obtenu qu'avec des couches épaisses et/ou des matériaux proches des métaux nobles. Or, l'écriture dans ces matériaux ne peut se faire qu'à des puissances élevées incompatibles avec les normes, en particulier du fait d'une absorption d'une conductivité thermique plus faible, importante et d'une température de fusion plus élevée. Par exemple, on ne peut pas écrire un signal dit "3T-10 3T" (où la notation 3T désigne la longueur des marques inscrites sur le disque et la longueur des intervalles entre ces marques), avec un bon rapport signal sur bruit (ce rapport reste inférieur à 20dB quelle que soit la puissance) dans une couche d'or de 20 nm ayant 15 une réflexion de 60%. Le même essai avec une couche de 10 nm, présentant une réflexion de 40% environ, aboutit à un résultat identique. Pour augmenter la sensibilité, on utilise en général des matériaux plus sensibles que les métaux nobles, comme le tellure par exemple. 20 Malheureusement, une seule couche de matériau sensible ne permet généralement pas d'obtenir une réflexion initiale suffisante. C'est le cas également avec un matériau comme le tellure utilisé par les Demandeurs comme on peut le voir sur la Figure 3. Cette figure 25 donne, en abscisses, la réflexion R en % dans une zone d'écriture et , en ordonnées, la puissance d'écriture minimale P (en mw). La réflexion obtenue ne dépasse jamais 50%, quelles que soient les épaisseurs et les conditions de dépôt, pour le matériau étudié.

8

augmenter la réflexion, une méthode Pour classique consiste à ajouter une couche d'or ou d'argent derrière la couche sensible [6] (par rapport à l'incidence de la lumière, de façon similaire au cas des disques à base de matériau organique). Cette couche réfléchissante est en général séparée de la couche sensible par une couche diélectrique. Pour certains mécanismes d'écriture, comme la formation de trous par exemple, la présence de cette couche diélectrique se traduit souvent par une perte de sensibilité et une baisse du rapport signal sur bruit. Il faut alors diminuer l'épaisseur de la couche sensible afin de diminuer la puissance de seuil. Malheureusement, Tes couches très fines ont en général un mauvais rapport signal sur bruit et une réflexion plus faible.

La présente invention a justement pour but de remédier à tous ces inconvénients.

Exposé de l'invention

5

10

15

cette fin, l'invention 20 préconise l'utilisation d'une structure très simple, sans matériau organique, et dont le fonctionnement est compatible avec les techniques et matériels connus. Cette structure comprend essentiellement un empilement bicouche constitué par une couche semi-réfléchissante 25 et d'une couche inorganique. L'écriture s'effectue à travers la couche semi-réfléchissante. La lecture se fait par la même face. Sous l'effet de l'irradiation, la couche inorganique subit des déformations de nature diverse : creux, criques, bulles, cavités, cratères, 30 bossages, dislocations, gonflements, bourrelets,

٠9

ablation partielle ou totale, reflux de matière etc. Des déformations peuvent éventuellement se produire dans la couche semi-réfléchissante et dans le substrat. puissances nécessaires à l'apparition Les 5 déformations sont compatibles avec celles qui sont mises en œuvre dans les appareils de gravure actuels. Elles ont en tout cas pour effet d'abaisser coefficient de réflexion de l'empilement bicouche, qui, en dehors des zones ainsi déformées peut atteindre 65%. La couche inorganique étant à l'origine de ces 10 déformations est appelée par la suite "couche active". Elle présente, en elle même, lorsqu'elle n'est pas déformée, un certain coefficient de réflexion mais qui est insuffisant. La couche semi-réfléchissante coopère 15 avec la couche inorganique pour accroître la valeur de cette réflexion.

De façon plus précise, la présente invention a pour objet un support d'enregistrement pour l'écriture d'informations, caractérisé en ce qu'il comprend un empilement bicouche constitué par une couche semiréfléchissante et une couche active inorganique, couche active inorganique étant apte à subir des déformations sous l'effet d'un rayonnement optique la d'écriture dirigé à travers couche semidéformations abaissant réfléchissante, ces le coefficient de réflexion de l'empilement.

20

25

30

L'invention a également pour objet un support d'enregistrement pour la lecture d'informations, caractérisé en ce qu'il comprend un empilement bicouche constitué par une couche semi-réfléchissante et une couche active inorganique, la couche active inorganique

10

présentant des déformations dans certaines zones, le coefficient de réflexion de l'empilement étant plus faible dans ces zones qu'en dehors.

De préférence, l'empilement bicouche est déposé sur un substrat. La couche semi- réfléchissante peut être disposée entre le substrat et la couche active inorganique. A l'inverse la couche active organique peut être disposée entre le substrat et la couche semi-réfléchissante. Dans le premier cas, le substrat doit être transparent. Ce substrat peut être gravé sous forme d'un sillon spiralé.

De préférence encore, la couche semi-réfléchissante est un métal. Ce métal peut êTre pris dans le groupe comprenant l'aluminium, l'argent, le cuivre, l'or, le zinc, le titane et leurs alliages. L'aluminium semble être un métal particulièrement approprié.

15

20

25

La couche semi-réfléchissante peut être réalisée en deux matériaux différents (ou plus). Elle peut comprendre par exemple une fine couche d'or et une fine couche d'argent.

De préférence, la couche active est en un matériau pris dans le groupe comprenant le tellure, l'antimoine, le sélénium, l'indium, le bismuth, l'arsenic et leurs alliages.

La couche active peut être en alliage SbTe ou SbSe avec un métal pris dans le groupe comprenant Al, Ag, Cu, Si, As.

Le matériau de la couche active peut en outre 30 comporter une certaine proportion d'azote.

11

Dans un mode de réalisation avantageux, une couche de protection est déposée sur l'empilement, côté couche active inorganique. Cette couche de protection peut être en silicone élastomère. Une couche intermédiaire diélectrique, organique ou inorganique, peut éventuellement être intercalée entre la couche active et la couche de protection. Cette couche intermédiaire favorise l'écriture et/ou la longévité du support par ses propriétés thermiques, chimiques et/ou mécaniques.

La présente invention a également pour objet un procédé d'écriture d'un support d'enregistrement tel qu'il vient d'être défini et qui est caractérisé en ce qu'on dirige un faisceau optique sur la couche active à travers la couche semi-réfléchissante, la puissance du faisceau optique étant apte à provoquer des déformations de la couche active.

La présente invention a encore pour objet un procédé de lecture d'un support d'enregistrement tel qu'il a été défini, caractérisé en ce qu'on dirige un faisceau optique sur la couche active à travers la couche semi-réfléchissante, la puissance du faisceau optique étant apte à donner naissance à un faisceau réfléchi dont l'intensité dépend des déformations de la couche active.

Brève description des dessins

10

15

20

25

- la figure 1, déjà décrite, montre le schéma de principe d'un disque à colorant organique ;
- 30 la figure 2 montre le lien entre le coefficient de réflexion d'une couche inorganique

12

unique en Sb₂Te₃ et la puissance lumineuse requise pour l'écriture ;

- les figures 3A et 3B illustrent schématiquement l'empilement bicouche conforme à l'invention avant et après écriture ;

5

25

30

- la figure 4 illustre un mode particulier de réalisation d'un support selon l'invention dans le cas d'un disque comprenant des sillons gravés dans un substrat avec couche de protection;
- la figure 5 rassemble des courbes montrant l'évolution du rapport signal sur bruit en fonction de la puissance d'écriture pour plusieurs épaisseurs de la couche semi-réfléchissante;
- les figures 6A et 6B montrent l'image d'un 15 support après illumination avec un laser respectivement de faible et de forte puissance ;
 - la figure 7 représente une image de points inscrits sur un disque vernis.

20 Description de modes particuliers de réalisation

La figure 3A montre un empilement bicouche conforme à l'invention. Cet empilement est constitué par une couche inorganique 30, dite par la suite "couche active", et une couche semi-réfléchissante 32, par exemple métallique. Cet empilement peut être écrit par un faisceaux lumineux 34 dirigé sur et à travers la couche réfléchissante 32. L'énergie déposée par le faisceau lumineux, après traversée de la couche semi-réfléchissante, déforme la couche active, comme il a été expliqué plus haut. La couche semi-réfléchissante

13

32 peut n'être pas déformée ou être déformée elle aussi.

La figure 3В montre l'empilement écriture et pendant l'opération de lecture. Le faisceau de lecture 36, d'intensité plus faible que le faisceau d'écriture 34, est dirigé vers la couche réfléchissante 32. Du fait de la déformation de la couche active 30 (qui dans le cas illustré, est liée à l'apparition d'un trou 33) et éventuellement de la couche semi-réfléchissante 32, le coefficient réflexion de l'empilement est plus faible dans les zones écrites Ze que dans les zones non écrites Zne. Le faisceau réfléchi 38 est donc moins intense dans Ies zones écrites Ze que dans les zones non décrites Zne ce qui permet, par des moyens optiques bien connus de l'homme du métier, de discriminer les différentes zones et de lire ainsi l'information enregistrée.

10

15

L'empilement bicouche qui vient d'être décrit
peut être déposé sur n'importe quel substrat et
notamment sur un substrat en forme de disque avec un
sillon gravé. C'est ce qui est représenté sur la figure
4 avec un certain nombre d'options. Sur cette figure on
voit un substrat transparent 40 gravé par des sillons
25 42 et un empilement bicouche 30-32 conforme à
l'invention.

En plus, dans le mode de réalisation illustré, le support comprend une couche diélectrique 44 et une couche de protection 46.

30 Le substrat 40 peut être en plastique (polycarbonate ou PMMA par exemple) avec des sillons de

14

largeur comprise entre 400 et 800 nm et de profondeur comprise entre 20 et 60 nm.

Sur la figure 4, la couche semi-réfléchissante 32 est déposée sur le substrat, ce qui suppose que celui-ci est transparent puisque l'écriture et la lecture s'effectuent à travers cette couche. Mais on peut aussi renverser la disposition et mettre la couche active sur le substrat, auquel cas c'est la couche de protection 46 qui doit être transparente. Dans ce cas, le substrat peut être opaque.

10

15

20

25

30

Le matériau de la couche semi-réfléchissante est choisi pour ses propriétés de réflexion (Al, Zn, Au, Ag, Cu ou leurs alliages par exemple). Il est souhaitable que cette couche absorbe peu la lumière. La couche semi-réfléchissante étant vue en premier par le faisceau lumineux, son épaisseur doit être ajustée au mieux pour augmenter la réflexion sans augmenter excessivement le seuil d'écriture. Cette épaisseur peut être comprise entre 4 et 10 nm par exemple.

La couche active est à la base du mécanisme d'écriture mais participe également à la réflexion de l'empilement. Son épaisseur est comprise entre 10 et 100 nm et doit être ajustée pour permettre de conserver une puissance d'écriture raisonnable avec une réflexion suffisante. Les conditions de dépôt de cette couche sont ajustées pour travailler avec une épaisseur optimale à réflexion constante. En effet, les trous, bulles, cavités etc. formés doivent être suffisamment grands pour que le contraste soit bon mais pas trop pour limiter le bruit de lecture. Or, la largeur des trous, bulles, cavités, etc... semble proportionnelle

dans certains cas à l'épaisseur de la couche. Le matériau de cette couche peut être par exemple : Te, Sb₂Te₃, In, Bi, Bi₂Te₃, SeTe, Se, As₃Se₃, As₂Te₃...

Des résultats de mesure sont présentés sur la 5 figure 5. Sur cette figure sont représentées les variations du rapport signal sur bruit (S/B) porté en ordonnées et exprimé en dB, en fonction de la puissance optique de lecture P portée en abscisses et exprimée en mW. Les courbes correspondent à une succession de zones 10 écrites de largeur 3T et de zones non écrites de même largeur, pour une vitesse linéaire de rotation du disque égale à quatre fois une vitesse de référence égale à 1,2 m/s soit, donc, 4,8 m/s. La couche active présentait une épaisseur de 25 nm. La couche semi-15 réfléchissante était une couche d'aluminium d'épaisseur variable, respectivement de 6 nm, 7 nm, 8 nm et 9 nm pour les courbes 51, 52, 53, 54. Le coefficient de réflexion de l'empilement dans les zones non écrites était respectivement de 46, 48, 50 et 51 % (alors que, 20 sans couche réfléchissante, elle ne serait que de 40 %).

L'empilement bicouche l'invention дe pour écrire et lire des informations. suffisant 25 Cependant, on peut, en option, ajouter à cet empilement protéger[,] le disque pour couches d'autres physico-chimiques matériaux des modifications (oxydation par exemple), pour éviter de l'endommager par des rayures ou des coups et pour lui éviter des 30 salissures et traces diverses dont la présence peut gêner la lecture ou l'écriture et dont le nettoyage risque d'endommager le disque. On peut ainsi ajouter une ou deux couches, voire plus, sachant que plus le nombre de couches ajoutées est élevé moins la solution devient intéressante économiquement. Généralement, la dernière couche déposée assure la protection mécanique. Il s'agit souvent d'un vernis déposé à la tournette, solidifié sous rayonnement ultraviolet, ayant une épaisseur de quelques microns. On peut aussi utiliser la technique du disque scellé.

5

10

15

20

25

La couche diélectrique intermédiaire 44 peut être ajoutée entre la couche active 30 et la couche de protection 46 comme illustré sur la figure 5, pour diverses raisons notamment pour favoriser mécaniquement et thermiquement la déformation de la couche active et renforcer sa résistance. Cette couche intermédiaire peut également isoler chimiquement la couche active de la couche de protection.

Les couches active et réfléchissante sont déposées de préférence par pulvérisation. Les conditions de dépôt des deux couches sont choisies pour obtenir une réflexion suffisante tout en conservant un seuil de puissance d'écriture compatible avec la plupart des appareils de gravure disponibles dans le commerce. Les couches intermédiaire et de protection peuvent être réalisées par pulvérisation ou par dépôt à la tournette selon la nature des matériaux et l'épaisseur des couches.

Quelques exemples de modes de réalisation vont maintenant être décrits. Il va de soi qu'ils ne limitent en rien la portée de l'invention.

Exemple 1

5 Le substrat est en polycarbonate. La couche réfléchissante est en aluminium d'épaisseur comprise entre 6 et 9 nm. Elle est déposée par pulvérisation avec un courant de cible de 500 mA et une pression d'argon de 3.10⁻³ mbar. La couche active est constituée 10 de Sb₂Te₃, d'épaisseur 25 nm (calculée à partir du temps de dépôt). Elle est déposée par pulvérisation avec une pression d'argon de 10⁻³ mbar et un courant de cible de 100 mA. Les réflexions mesurées en faisceau focalisé à l'aide d'un testeur de CD-R du commerce donnent :

15 Numéro de l'échantillon 1 2 3 4 5

Epaisseur d'aluminium (nm) 0 6 7 8 9

Réflexion (unité arbitraire) 1 1,15 1,2 1,25 1,28

Les variations du rapport signal sur bruit en fonction de la puissance d'écriture obtenue à la 20 vitesse 4,8m/s pour les échantillons comportant une couche d'aluminium sont représentées sur la figure 6. Pour une vitesse de 1,2 m/s le rapport signal sur bruit est supérieur à 45 dB pour une puissance supérieure à 5,5 mW pour les échantillons 2 et 3, supérieure à 7 mW 25 pour l'échantillon 4. Le rapport signal sur bruit est supérieur à 43 dB à partir de 8 mW pour l'échantillon 5. A la vitesse double (2,4m/s) le rapport signal sur bruit est supérieur à 47 dB à partir de 7,5 mW pour les et 3, à partir de 10 mW pour échantillons 2 30 l'échantillon 4.

5

10

15

20

25

30

Exemple 2

Le substrat est en polycarbonate. La couche réfléchissante est en aluminium d'épaisseur comprise entre 6 et 9 nm. Elle est déposée par pulvérisation avec un courant de cible de 500 mA et une pression d'argon de 3.10⁻³ mbar. La couche active constituée de Sb₂Te₃, d'épaisseur 30 nm (calculée à partir du temps de dépôt). Elle est déposée par pulvérisation avec une pression d'argon de 10⁻³ mbar et un courant de cible de 250 mA. Les réflexions mesurées en faisceau focalisé à l'aide d'un testeur de CD-R du commerce donnent : Numéro de l'échantillon 9 ._ Epaisseur d'aluminium (nm) 6 7 8 0 1,12 1,19 1,23 1,30 Réflexion (unité arbitraire) 1

L'échantillon 2 a un rapport signal sur bruit supérieur à 42 dB à partir de 4 mW en vitesse 1,2m/s, 46 dB à partir de 6 mW en vitesse 2,4m/s et 48 dB à partir de 10 mW en vitesse 4,8m/s. L'échantillon 3 a un rapport sur bruit supérieur à 45 dB à partir de 6,5 mW en vitesse 1,2m/s, 8,5 mW en vitesse double et 12 mW en vitesse quadruple. Tous ces tests ont été effectués avec un signal composé d'alternances de zones de même longueur.

Exemple 3

Le substrat est en polycarbonate. La couche est en aluminium de 7 nm d'épaisseur, la couche active a 40 nm d'épaisseur et est constituée de Sb₂Te₃. Une couche de protection de 40 nm en silice est prévue. La réflexion du disque en zone non écrite est de 60 %. Cet empilement a été irradié par un faisceau lumineux de longueur d'onde est comprise entre 7700 Å et 7900 Å les

résultats se l'irradiation ont été observés par AFM (Atomic Force Microscope). La surface du disque (côté couche de silice), pour une puissance faible et une puissance forte est représentée sur les figures 6A et 6B.

Exemple 4

5

10

25

Le substrat est en polycarbonate. La couche active de 20 nm est composée de $\mathrm{Sb_2Te_3}$. Elle est réalisée par pulvérisation. La couche semi-transparente est en alliage aluminium-chrome de 7 nm d'épaisseur. Un vernis de protection a été déposé à la tournette et solidifié avec une lampe UV. La figure 7 montre les points inscrits sur le disque.

Exemple 5

Le substrat est en polycarbonate. La couche active de 28 nm est en Sb₂Te₃. Elle est réalisée par pulvérisation. La couche semi-transparente est en aluminium de 6 nm d'épaisseur. Le rapport signal sur bruit a été mesuré avant application d'une couche de protection. les puissances de seuil sont compatibles avec la norme CD-R : 4 mW en vitesse 2,4 m/s, 5 mW en 4,8 m/s, 8 mW en 9,6 m/s.

Avec une couche d'élastomère, les puissances de seuil restent compatibles avec la norme CD-R : 4 mW en vitesse 2,4 m/s, 5 mW en 4,8 m/s et 9 mW en 9,6 m/s.

A la vitesse 145,4 m/s la puissance de seuil est de 13 mW pour un rapport signal sur bruit de 47 dB, avec la couche d'élastomère.

30 S'agissant de la longueur d'onde de la lumière servant à écrire et lire les données, on peut donner

les indications suivantes. Pour la famille CD (CD-R) c'est autour de 8000 Å (proche infrarouge) qu'on travaillera, les fourchettes étant précisées dans les normes. Elles sont différentes pour la lecture et l'écriture. Pour le DVD (DVD-R par exemple) on se placera dans le rouge autour de 6300 ou 6500 Å. D'autres longueurs d'onde, dans le vert ou dans le bleu peuvent également être utilisées.

21

REFERENCES CITEES :

- 1. "Principles of optical disc systems", G. Bouwhuis et al., ed. Adam Hilger Ltd, chapitre 6 "Materials for on-line optical recording" p. 210-227.
- 5 2. "Ablative hole formation process in thin tellurium-alloy films", M. Chen et al. appl.Phys.Lett. 41(9) 894-896 (1982).
 - 3. "Thin films for optical data storage", W.-Y. Lee, J.Vac.Sci.Technol. A3 (3) 640-646 (1985).
- 10 4. "Laser recording in tellurium suboxide thin films", Y-S Tyan et al. J.Appl.Phys. 59(3) p. 716 (1986)
 - 5. "Textured germanium optical storage medium", H.G.Craighead, Appl. Phys. Lett. 40(8) p. 662 (1982) —
 - 6. EP 0605891 et EP 0747895

15

5

10

15

30

22

REVENDICATIONS

- 1. Support d'enregistrement pour l'écriture d'informations, caractérisé en ce qu'il comprend un empilement bicouche constitué par une couche semi-réfléchissante (32) et une couche active inorganique (30), la couche active inorganique (30) étant apte à subir des déformations sous l'effet d'un rayonnement optique d'écriture (34) dirigé à travers la couche semi-réfléchissante (32), ces déformations abaissant le coefficient de réflexion de l'empilement. (Fig. 4A)
- 2. Support d'enregistrement pour la lecture d'informations, caractérisé en ce qu'il comprend un empilement bicouche constitué par une couche semi-réfléchissante (32) et une couche active inorganique (30), la couche active inorganique (30) présentant des déformations dans certaines zones (Ze), le coefficient de réflexion de l'empilement étant plus faible dans ces zones (Ze) qu'en dehors (Zne). (Fig.4B)
- 3. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel l'empilement bicouche est déposé sur un substrat transparent (40), la couche semi-réfléchissante (32) étant disposée entre le substrat (40) et la couche active inorganique (30).
 - 4. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel l'empilement bicouche est déposé sur un substrat, la couche active inorganique (30) étant disposée entre le substrat et la couche semi-réfléchissante.

5

10

15

20

- 5. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 dans lequel la couche semi-réfléchissante (32) est en métal.
- 6. Support d'enregistrement selon la revendication 5, dans lequel le métal de la couche semi-réfléchissante (32) est pris dans le groupe comprenant Al, Ag, Cu, Au, Zn, Ti et leurs alliages.
 - 7. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 5, dans lequel la couche semi-réfléchissante comprend deux couches métalliques.
 - 8. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la couche active inorganique (30) est en matériau pris dans le groupe comprenant Te, Sb ou Se, et leurs alliages.
 - 9. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la couche active inorganique (30) est en alliage SbTe avec un élément pris dans le groupe comprenant Al, Ag, Cu, Si, As.
 - 10. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la couche active inorganique (30) est en alliage de SbSe avec un élément pris dans le groupe comprenant Al, Ag,
- 25 Cu, Si, As.
 - 11. Support d'enregistrement selon l'une quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la couche active inorganique (30) est en alliage SeTe avec un élément pris dans le groupe comprenant Al, Ag,
- 30 Cu, Si, As.

WO 01/93256

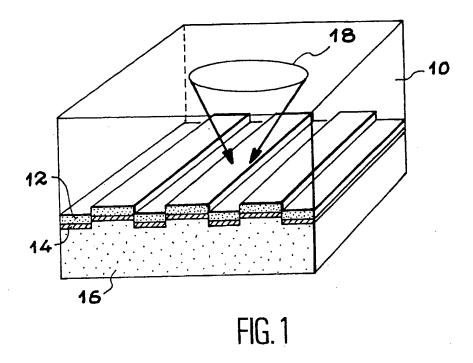
d'enregistrement selon 12. Support quelconque des revendications 8 à 10, dans lequel le matériau inorganique de la couche active (30) comporte une proportion d'azote.

24

- d'enregistrement selon l'une 13. Support 5 quelconque des revendication 1 et 2, dans lequel une couche de protection (46) est déposée sur l'empilement.
- d'enregistrement selon 14. Support revendication 13 comportant en outre une intermédiaire diélectrique (44) entre l'empilement et 10 la couche de protection (46).
 - d'enregistrement selon 15. Support quelconque des revendications 13 et 14 dans lequel-la couche de protection (46) est en silicone élastomère.
- l'une quelconque des selon 16. Support 15 revendications 1 et 2 dans lequel la couche semiréfléchissante (32) a une épaisseur comprise entre 4 et 10 nm.
- d'enregistrement selon 17. Support quelconque des revendications 1 et 2 dans lequel la 20 couche active inorganique (30) a une épaisseur comprise entre 10 et 100 nm.
 - d'écriture d'un support 18. Procédé d'enregistrement selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on dirige un faisceau optique sur la couche active (30) à travers la couche semi-réfléchissante (32), la puissance du faisceau optique étant apte à provoquer des déformations de la couche active (30).

25

19. Procédé de lecture d'un support d'enregistrement selon la revendication 2, caractérisé 30 en ce qu'on dirige un faisceau optique sur la couche active (30) à travers la couche semi-réfléchissante (32), la puissance du faisceau optique étant apte à donner naissance à un faisceau réfléchi dont l'intensité dépend des déformations de la couche active (30).



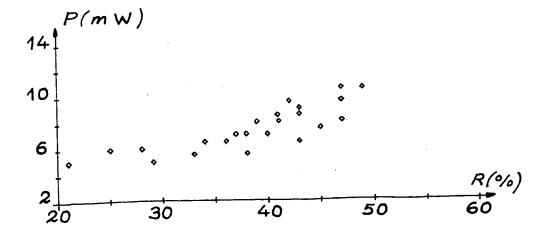
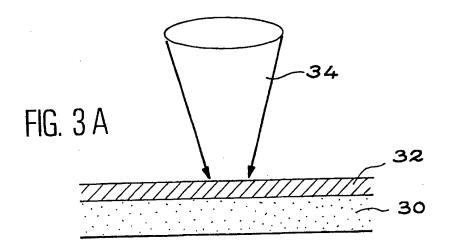
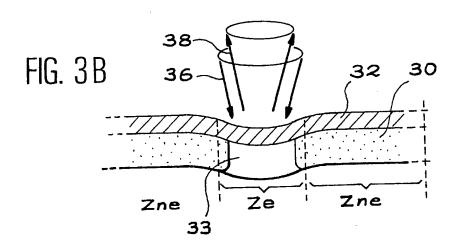


FIG. 2





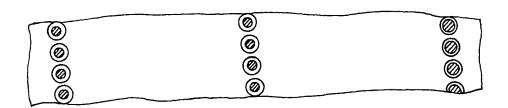


FIG. 7

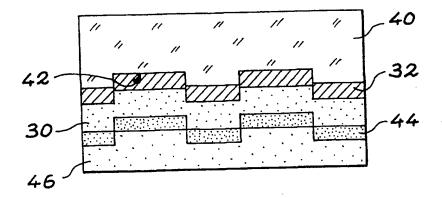


FIG. 4

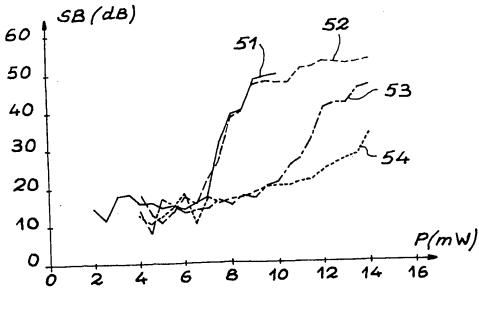


FIG. 5

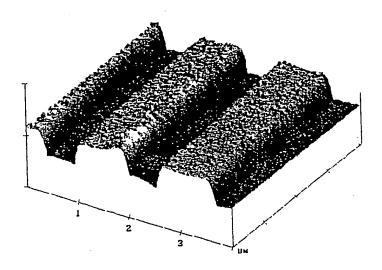


FIG. 6A

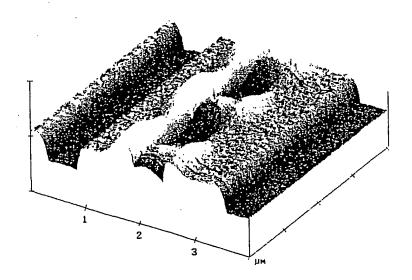


FIG. 6B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

onal Application No PTT/FR 01/01660

		101/11	01/ 01000
CLASSIFI PC 7	CATION OF SUBJECT MATTER G11B7/24		
ccording to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
. FIELDS S	SEARCHED currentation system followed by classification system followed by classification	ion symbols)	
PC 7	G11B	,	
ocumentatio	on searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fle	elds searched
	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and where practical search terms	s used)
		and and, more presented, events	·
EPO-Int	ternal		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	-lavest possess	Relevant to claim No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	elevani passages	
	WE T ATO SOO A (NICUIDA TETSUVA	FT AI)	1-6,
A	US 5 479 382 A (NISHIDA TETSUYA 26 December 1995 (1995-12-26)	LI NE)	8-11,13,
			14,16,17
	column 4, line 24 -column 7, li	ne Z	
Α	GB 2 052 080 A (INST ELEKTRODIN	AMIKI	1-8,16,
^	AKADEMIT) 21 January 1981 (1981:	-01-21)	17
А	page 1, line 4 -page 2, line 34; examples 1-3,19		10
Α	EP 0 822 543 A (IND TECH RES IN	ST)	1-4
Α.	4 February 1998 (1998-02-04)		
	column 3, line 24 - line 46; fi column 4, line 18 - line 49	gure 1	
Α	US 5 753 413 A (ANZAI YUMIKO E	T AL)	1-4, 8-11,17
•	19 May 1998 (1998-05-19)		0-11,17
	column 2, line 13 -column 6, li		
		-/	
X Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members a	re listed in annex.
	categories of cited documents :	*T* later document published after	the International filing date
IA dogue	mont defining the general state of the lart which is not	or priority date and not in con cited to understand the princi	MICI WITH THE ADDISCATION DUT
cons	sidered to be of particular relevance er document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevan	nce; the claimed invention
filing	g date	cannot be considered novel of involve an inventive step who	en the document is taken alone
whic	th is cited to establish the publication date of allother. Stop or other special reason (as specified)	'Y' document of particular relevant cannot be considered to involve	ive an inventive step when the
O, qocn	iment referring to an oral disclosure, use, exhibition or er means	document is combined with o ments, such combination be	one or more other such docu- ing obvious to a person skilled
'B' docu	in iteals iment published prior to the international filing date but r than the priority date claimed	in the art. '&' document member of the sarr	ne patent family
	ne actual completion of the international search	Date of malling of the Interna	ational search report
	2 August 2001	13/08/2001	
Name an	nd mailing address of the ISA	Authorized officer	
Name an	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2		
l	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Quaranta, L	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

onal Application No PCI/FR 01/01660

.(Continua	(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passa	ges Relevant to claim No.	
1	US 5 709 978 A (HIROTSUNE AKEMI ET AL 20 January 1998 (1998-01-20) the whole document) 1,2,8-11	
		,	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

ational Application No

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5479382 A	26-12-1995	JP 7065414 A	10-03-1995
GB 2052080 A	21-01-1981	NONE	
EP 0822543 A	04-02-1998	NONE	
US 5753413 A	19-05-1998	JP 8258418 A	08-10-1996
US 5709978 A	20-01-1998	DE 4421221 A JP 7223372 A KR 153033 B US 5912104 A	22-12-1994 22-08-1995 15-12-1998 15-06-1999

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

ide Internationale No

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G11B7/24

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) C 1B 7 611B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal

C. DOCUME	NTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	no. des revendications visées
Catégorie °	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	110. des revendications viscos
А	US 5 479 382 A (NISHIDA TETSUYA ET AL) 26 décembre 1995 (1995-12-26)	1-6, 8-11,13, 14,16,17
	colonne 4, ligne 24 -colonne 7, ligne 2	
A	GB 2 052 080 A (INST ELEKTRODINAMIKI AKADEMII) 21 janvier 1981 (1981-01-21)	1-8,16, 17 10
Α	page 1, ligne 4 -page 2, ligne 34; exemples 1-3,19	
A	EP 0 822 543 A (IND TECH RES INST) 4 février 1998 (1998-02-04) colonne 3, ligne 24 - ligne 46; figure 1 colonne 4, ligne 18 - ligne 49	1-4
А	US 5 753 413 A (ANZAI YUMIKO ET AL) 19 mai 1998 (1998-05-19) colonne 2, ligne 13 -colonne 6, ligne 67	1-4, 8-11,17
	-/	

χ Voir la sulte du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
 "A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette dale "L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou lous autres moyens 	"T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mals cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X' document particulièrement perfinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré Isolèment "Y' document particulièrement perfinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtler "&' document qui fait partie de ta même famille de brevets
postérieurement à la date de priorité revendiquée Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche Internationale
2 août 2001	13/08/2001
Nom et adresse postate de l'administration chargée de la recherche internationa	le Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Quaranta, L

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

de Internationale No
PCT/FR 01/01660

.(suite) DO	CUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		no, des revendications visées
atégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages	perunents	No. usa revended and a possi
	US 5 709 978 A (HIROTSUNE AKEMI ET AL) 20 janvier 1998 (1998-01-20) le document en entier		1,2,8-11
i i			
	·		

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

de Internationale No

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5479382 A	26-12-1995	JP 7065414 A	10-03-1995
GB 2052080 A	21-01-1981	AUCUN	
EP 0822543 A	04-02-1998	AUCUN	
US 5753413 A	19-05-1998	JP 8258418 A	08-10-1996
US 5709978 A	20-01-1998	DE 4421221 A JP 7223372 A KR 153033 B US 5912104 A	22-12-1994 22-08-1995 15-12-1998 15-06-1999